

# ウェハ反り・応力 2D/3Dマッピング測定装置 MOS Ultra Scan / Thermal Scan



**平行配列ビームスポット(特許)による高い分解能と再現性!!**



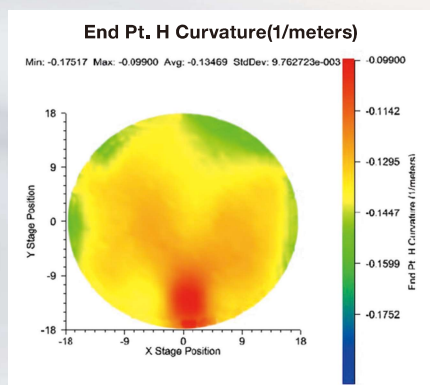
## 特徴

### 共通機能

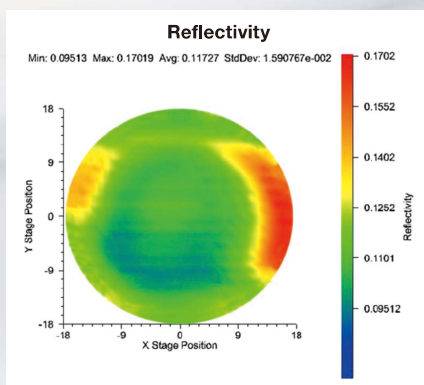
- エタロンを使用した**平行配列ビームスポット**を作り各スポット間隔を測定
- 反り、反り高さ、薄膜応力、反射率、膜厚(オプション)を**2D/3Dマッピング**
- 対象：**半導体ウェハ、光学ミラー、レンズ、ガラス基板**など

### MOS Thermal Scan

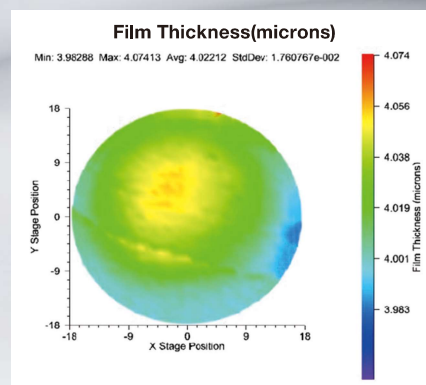
- **真空加熱チャンバー、ガス導入機構付**
- 加熱温度：**ラインスキャン1000℃、2D/3Dマッピング600℃**
- **プロセスガス雰囲気中での加熱時**における半導体ウェハの反り量などの測定



KSA MOS UltraScan curvature map of a commercial GaN on sapphire template.



KSA MOS UltraScan reflectance map of a commercial GaN on sapphire template.



KSA MOS UltraScan thickness map of a commercial GaN on sapphire template.